# PARTICLE OPTICS IN THE TIT-RFQ CALCULATED USING A 3D PARTICLE-IN-CELL CODE

Yoshiyuki OGURI and Masahiro OKAMURA Research Laboratory for Nuclear Reactors Oh-okayama 2, Meguro-ku, Tokyo 152, JAPAN

## ABSTRACT

Beam dynamics in an RFQ at the Tokyo Institute of Technology was analyzed using a 3D particle-in-cell computer code. In this calculation not only space charge force between each macroparticles but also 3D image charge field were included. Beam transmission performance was calculated for two types of vane-tip design with different tip curvature radii. These results are compared with ones obtained with the idealized linear two-term potential. The old vane tip design with a small tip curvature radius has given very poor beam transmission efficiency which cannot be accepted for the actual machine.

三次元粒子コードを用いた東工大 RFQ におけるビーム光学計算

#### 1. はじめに

東京工業大学原子炉工学研究所にて建設中の重イ オンRFQ(TIT-RFQ)の設計においては、当初シャ ントインピーダンスの向上を目指して先端曲率半 径が小さいベインの採用が検討された[1,2].しか し東大核研の徳田により開発された PARMTEQ-H コードを用いてベイン間電界中の高調波成分を考慮 してビーム軌道計算を行ったところ、 $\rho = 0.75r_0(\rho)$ : ベイン先端曲率半径, ro:平均ボア径)の設計では特 に大電流ビーム加速時にビーム透過率が非常に低 くなることが判明した。そこで加速電力効率を多 少犠牲にしても、より高いビーム透過率を得るた め、高調波成分の少ない $\rho = r_0$ の構造の採用を検 討することにした、PARMTEQ-H の結果をフィー ドバックしながら、さらに各パラメーターを $\rho = r_0$ の構造に最適化したところ、ビーム透過率の大幅 な改善が期待されるようになった[3].

一方 TIT-RFQ では主に予算的制約からビーム径 に対する四重極チャンネルの内径,すなわち safety factor[4]を小さく取る必要があった.そのためビー ムが電極表面から近く,ビームの鏡像電荷力の影 響が比較的大きいことが予想される.鏡像電荷は イオンと反対の電荷を持つため、イオンは鏡像か ら引力を受ける.従って鏡像はビームを発散させる

効果を持ち, RFQ のビーム透過率はさらに低下す る恐れがある. PARMTEQ-H コードではこの鏡像 電荷効果は考慮されていない。そこで新しく開発 された粒子コード (particle-in-cell code) により同 様なビーム光学計算を行い、 $\rho = r_0$ の構造を持つ 新しい設計のビーム光学的性能を確認することに した.このコードでは各マクロ粒子間に働く三次 元空間電荷反発力を計算しているだけでなく、三 次元鏡像電荷力の評価を可能とするために高速の Poisson solver が組み込まれている. 理想化された双曲線状断面ベインによって実現さ れる two-term potential,及び現実的構造である  $\rho = r_0, \rho = 0.75 r_0$ の三種のベイン間ポテンシャル についての計算結果を比較し、 $\rho = r_0$ の採用によ り、 $\rho = 0.75r_0$ に比べてどの程度の改善が見られる かを調べる.また PARMTEQ[5] コードによる結 果との比較を行う. 鏡像電荷力の有無が透過率に

### 2. 計算方法

与える影響についても検討する.

ビーム光学計算には三次元粒子コード QLASSI[6] を用いた.マクロ粒子の個数は,計算時間の都合 上現在最大 2<sup>9</sup>個である. 各ベイン断面形状に対応する高調波成分を含む RF 電場は Fourier-Bessel 級数で表される。各項の係 数  $A_{nm}$ はセル長、ベインの変調度等に依存するが、 これらは Crandall による表 [7] を内挿して求めた。 図 1 は考察した三種類のポテンシャルについての  $A_{nm}$ の変化をセル番号の関数として示す。





空間電荷力は他の全てのマクロ粒子からの単極クー ロン力の和として計算される.

また鏡像電荷力を評価するため、イオンの空間電

荷と電極から構成される三次元 Dirichlet 境界値問 題を各時間積分ステップ毎に解き,各マクロ粒子・ の感じる鏡像電場を求めている.バンチした細い ビームが変調された四重極チャンネル内にあると きの空間電荷+鏡像電荷による yz平面内の電場の ベクトル図を図2に示す.



図2: 空間電荷+鏡像電荷による電場の一例.

全電場は以上の和で表され,各粒子の運動方程式 を4次のRunge-Kutta法で積分して軌道を求める. 計算は東京工業大学総合情報処理センターのCDC-ETA10スーパーコンピューターを用いて行った.計 算時間は1加速セルあたり20秒程度である.

### 3.計算結果及び考察

図3はセル番号を横軸とする<sup>16</sup>O<sup>+</sup>ビームの透過率 及び損失率のプロファイルである.(a)と(b)はtwoterm potentialに対する結果である.ビーム電流ゼ ロのとき透過率は89%となり,PARMTEQ 計算と の一致は良い.ビーム電流が10mAのとき,透過率 は73%に低下した.比較のため,(b)にPARMTEQ コードによる計算結果を示す.透過率のプロファイ ルに多少の差異が認められるが.これはQLASSI と PARMTEQ とにおける空間電荷効果の計算方 法の違いによるものと解釈可能である.

図 3(c)-(f) は現実的な構造である非双曲線断面の ベインに対する結果である. ビーム電流がゼロの ときにも既に透過率は低下している. ビーム電流 10mA に対しては, two-term potential のときより も透過率は大きく低下し, 特に $\rho = 0.75r_0$ の設計で は 34%となる.  $\rho = r_0$ についての結果は PARM-TEQ-H による結果 [3] と大体一致している.



図 3: ビーム透過率及び損失率のプロファイル.



図 4: buncher section 終端部付近におけるビーム断面形状.

鏡像電荷がどの程度ビーム透過率に影響を与えて いるかを調べるため,鏡像力をON/OFFしてその 影響を調べた.図3(f)における一点鎖線は鏡像電 荷力をOFFとしたときの結果である.ビーム透過 率はわずかに増加した.従って,予想されたよう に鏡像電荷力はビーム透過率をわずかに減少させ る効果があることが分かった.この傾向はGuy[8], Junior[9]らによっても報告されている.

図4は buncher section の終り付近に位置する第 150 セルにおけるビーム断面形状である.two-term potential を用いたとき、粒子分布は入射時と同様 に大体楕円型である.しかし非双曲線断面のベイ ンを使うと、ビーム断面形状に変形が見られる.特 に $\rho = 0.75r_0$ の場合、断面はむしろ菱型に近い.こ の菱型状変形は、ベイン先端に誘起された表面電 荷(イオンの空間電荷の鏡像に対応)からの引力 により助長されている可能性がある.このような 形状は少なくとも8極場の発生源となる.従って 空間電荷効果の解析には時々刻々変化する三次元 的粒子分布を反映した計算手法を用いるべきであ ることが分かる.

## 4. 結論

PARMTEQ-H コードで予想されたように,  $\rho = r_0$ の構造は理想的な双曲線状断面のベインの性能に は及ばないが,  $\rho = 0.75r_0$ に比較すると大幅な改善 となることが確認できた.

 $\rho = 0.75r_0$ の構造はビーム透過率が著しく低く,や はり実機には採用できないとの結論に到達した.た とえこの構造を採用しても, $\rho = r_0$ に比較して数 %の電力効率向上しか期待できない [1] ことも,こ の構造を採用しなかった理由のひとつである.

ビーム径の safety factor[4] を増やす, つまり広い四 重極チャンネルに細いビームを通せば,  $\rho = 0.75r_0$ の構造でも高い透過率が得られることは計算によ り確認した.しかし四重極チャンネルの径を大き くすれば,加速電力効率は急速に低下し,先端曲 率半径の小さいベインを用いる意味は消失する. 今回考察した構造では,鏡像電荷力のビーム透過 率への影響は明確に分かる程度ではあるものの,小 さいことが分かった(1%程度).従っておおまか な設計においては鏡像電荷効果を考慮する必要性 は少ない.しかし将来放射性物質の消滅処理,慣 性核融合等で RFQ の利用が現実化し,極めて強い ビームを加速する場合,数%の損失も問題となる可 能性がある.この場合は鏡像電荷効果の詳細な評 価が必要であろう.

PARMTEQ-H 計算においては東大核研の徳田 登 氏の多大な御援助を頂きました.

### 参考文献

- O. Takeda, K. Satoh, Y. Tanabe, S. Kawazu, M. Yamaguchi, M. Okamura, T. Hattori, Y. Oguri and N. Tokuda: Proc. 3rd European Particle Accelerator Conf., Berlin, 1334 (1992).
- [2] M. Okamura, Y. Oguri, Y. Takahashi, T. Hattori, O. Takeda, K. Satoh and Y. Tanabe: Proc. 1992 Linear Accelerator Conf., Ottawa, Ontario, 67 (1992).
- [3] M. Okamura, Y. Oguri, Y. Takahashi, T. Hattori, O. Takeda, K. Satoh, T. Miura, Y. Tanabe and N. Toduda: Proc. International Symposium on Heavy Ion Inertial Fusion, Frascati, Italy (1993), to be published.
- [4] S.Yamada: Proc. 1981 Linear Accelerator Conf., Santa Fe, NM, LA-9234-C, 316 (1982).
- [5] K. R. Crandall, R. H. Stokes and T. P. Wangler: Proc. 1979 Linear Accelerator Conf., Montauk, N.Y., 205 (1979).
- [6] Y. Oguri, M. Okamura, O. Takeda, K. Satoh and T. Hattori: J. Nucl. Sci. Technol. 30, 477 (1993).
- [7] K. R. CRANDALL: Los Alamos Report LA-9695-MS, (1983).
- [8] F. W. Guy: Proc. 1991 IEEE Particle Accelerator Conf., San Francisco, CA, 3032 (1991).
- [9] P. Junior, A. Harth and H. Deitinghoff: Proc. 1992 Linear Accelerator Conf., Ottawa, Ontario, 513 (1992).